

# FIMS評価用治具 00MK036B

弊社は(株)半導体先端テクノロジーズ(Selete:Semiconductor Leading Edge Technologies,Inc.)様から300mmウエハプロセスラインに必要な数々の治具類の開発設計と販売を要請され、スタンダードの策定と円滑で速やかな量産設備の構築に貢献してまいりました。特にFIMS評価用治具は、高い互換性でFOUPとLoadportをつなぐラインの立ち上げ基準治具と位置づけられ、様々な設備メーカーやウエハプロセスの現場で活躍。使いやすさと迅速なアフターサービス、多数の販売実績で多くのユーザー様から厚い信頼をいただいています。



## 概要

- プロセスのレジストレーションピン・ラッチキーの位置評価を行います。
- コーナーエッジを切り欠き、ロードポートカバーを付けたままで評価可能です。
- 高精度を維持しながら搬送に威力を発揮する、クリーンルーム仕様の専用ケース付き。

## 評価項目

- レジストレーションピンの位置・再現性
- ラッチキーの位置・再現性
- ドッキング位置のFDP~FIMSフレーム/ドア面までの距離
- HDPとFIMS面・フレームシール面の垂直度
- レジストレーションピンおよびラッチキーの太さ・垂直度

